

## О ПРИРОДЕ ДЕФЕКТОВ С УРОВНЕМ $E_c$ —0.18 эВ В КРЕМНИИ

Кучинский П. В., Ломако В. М., Шахлевич Л. Н.

Установлено, что энергетическому уровню  $E_c$ —0.18 эВ в «бескислородном» кремнии могут соответствовать по крайней мере четыре типа дефектов, отжигающихся в три стадии. Один из дефектов идентифицирован как конфигурационно-бистабильный.

В образцах с большим содержанием кислорода обнаружена колебательная реакция перестройки дефектов с уровнем  $E_c$ —0.18 эВ в дефект с уровнем  $E_c$ —0.34 эВ.

*Введение.* Обилие результатов по кинетике накопления и параметрам радиационных дефектов в кремнии не привело к достоверному установлению природы многих центров. В последние годы стал широко применяться метод емкостной спектроскопии, имеющий достаточно высокое «спектральное» разрешение и позволяющий не только определять предельно низкие концентрации электрически активных центров, их энергетические уровни в запрещенной зоне, сечения захвата носителей, но и судить о симметрии центров, их взаимодействии с решеткой в различных зарядовых состояниях. Данные, полученные этим методом, заставляют по-иному взглянуть на природу многих радиационных дефектов в кремнии, в частности на природу известного центра с энергетическим уровнем  $E_c$ —0.18 эВ. На сегодняшний день сложилось мнение, что в материале с высоким содержанием кислорода ( $\sim 10^{17} \div 10^{18} \text{ см}^{-3}$ ) этот уровень обусловлен комплексом вакансия—кислород ( $A$ -центр), а в кремнии с низким содержанием кислорода ( $\leqslant 10^{16} \text{ см}^{-3}$ ) наряду с  $A$ -централами образуются дефекты, содержащие углерод [<sup>1-3</sup>].

В данной работе методом нестационарной емкостной спектроскопии исследовались стабильность и перестройка радиационных дефектов с уровнем  $E_c$ —0.18 эВ в  $n$ -кремни с различным содержанием кислорода.

*Образцы.* Образцы представляли собой  $p-n$ -структуры на основе зонного и нейтронно легированного (НЛК) кремния ( $n_0 = 10^{14} \text{ см}^{-3}$ ). Концентрация кислорода в исходных кристаллах НЛК составляла  $\leqslant 2.5 \cdot 10^{15} \text{ см}^{-3}$ .  $p-n$ -Переходы на основе НЛК создавались имплантацией бора с последующим формированием в атмосфере аргона («бескислородные» образцы). Также создавались  $p-n$ -переходы диффузией бора из боросиликатного стекла при  $1150^\circ\text{C}$  в атмосфере кислорода в НЛК и зонный кремний («кислородные» образцы). Оценки концентрации кислорода в зондируемой области показывают, что в результате диффузии она достигает  $\sim 3 \cdot 10^{17} \text{ см}^{-3}$ . Кроме того, изучались  $p^+ - n - n^+$ -структуры, полученные эпитаксией  $n$ -слоя на  $n^+$ -подложку ( $n_0 = 3 \cdot 10^{15} \text{ см}^{-3}$ ) с последующей эпитаксией  $p^+$ -слоя.

Образцы облучались  $\gamma$ -квантами  $^{60}\text{Co}$  ( $I = 1.05 \cdot 10^{12} \text{ с}^{-1} \cdot \text{см}^{-2}$ ,  $T \leqslant 40^\circ\text{C}$ ). Проводился изохронный отжиг всех структур ( $\Delta t = 30$  мин,  $T = 100 \div 400^\circ\text{C}$ ).

*Экспериментальные результаты и их обсуждение.* Эффективность введения дефектов с уровнем  $E_c$ —0.18 эВ в кислородных и эпитаксиальных образцах практически одинакова, а в бескислородных значительно выше (в  $\sim 2$  раза). На рис. 1 представлены результаты отжига дефектов с уровнем  $E_c$ —0.18 эВ в бескислородных и эпитаксиальных структурах. В бескислородных образцах наблюдаются три стадии отжига:  $100 \div 140$ ,  $200 \div 280$  и  $320 \div 400^\circ\text{C}$ . С учетом литературных данных по отжигу комплекса вакансия—кислород [<sup>4</sup>] стадию

в области  $320 \div 400$  °C можно отнести к отжигу A-центра. Следует отметить, что скорость введения A-центра практически одинакова во всех трех типах образцов.

Исходя из предположения о подвижности E-центра как целого [5] и данных по его температурной стабильности в некоторых работах [6, 7] делается вывод о том, что стадия отжига дефектов с уровнем  $E_c = -0.18$  эВ в области  $100 \div 140$  °C обусловлена их взаимодействием с E-центром. Однако, как видно из рис. 1, a, в нашем случае такое предположение не оправдано, поскольку концентрация центров  $E_c = -0.43$  эВ составляет  $\sim 10\%$  от доли дефектов с уровнем  $E_c = -0.18$  эВ, отжигающихся на первой стадии. Более того, в структурах на основе эпитаксиального кремния в области отжига центров  $E_c = -0.43$  эВ концентрация дефектов с уровнем  $E_c = -0.18$  эВ не уменьшается, а возрастает (рис. 1, б). Это свидетельствует о необоснованности интерпретации первой стадии отжига дефектов с уровнем  $E_c = -0.18$  эВ, так же как их взаимодействие с E-центром.

Попытка установить кинетику накопления дефектов, отжигающихся на первой стадии, путем выделения указанной стадии в образцах, облученных различными потоками, показала, что эффективность их образования колеблется

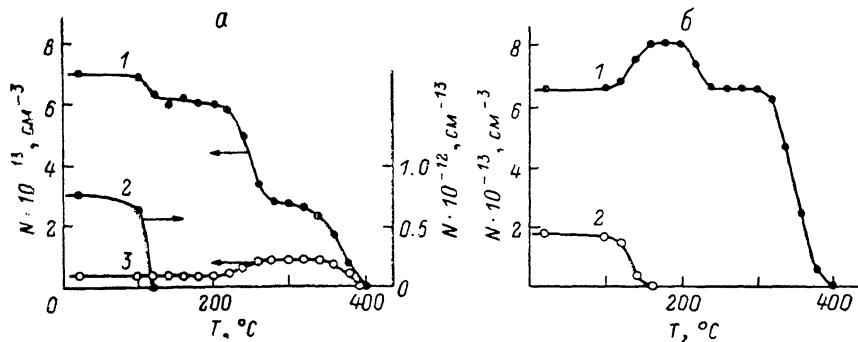


Рис. 1. Изменение концентрации центров в «бескислородных» (a) ( $\Phi_\gamma = 1 \cdot 10^{17} \text{ см}^{-2}$ ) и эпитаксиальных (б) ( $\Phi_\gamma = 2.9 \cdot 10^{17} \text{ см}^{-2}$ ) структурах в процессе изотермического отжига.

1 —  $E_c = -0.18$ , 2 —  $E_c = -0.43$ , 3 —  $E_c = +0.34$  эВ.

от образца к образцу в пределах порядка. Такая ситуация возможна, если в состав указанных дефектов входят атомы примеси, неоднородно распределенной по кристаллу. Можно предположить, что такой примесью является углерод [8]. Однако в исследованных структурах в интервале  $100 \div 200$  °C не наблюдается изменения концентрации дефектов с уровнем  $E_c = +0.34$  эВ (рис. 1, a), свойства которых описаны в [9] и которые, по литературным данным, содержат углерод [ $10^{-12}$ ]. Следовательно, в состав дефектов с уровнем  $E_c = -0.18$  эВ, отжигающихся на первой стадии, углерод, по-видимому, не входит.

Исследование нестационарной емкости, обусловленной дефектами с уровнем  $E_c = -0.18$  эВ, в зависимости от заполнения ловушек электронами позволило установить, что амплитуда сигнала зависит от длительности импульсов заполнения ловушек электронами  $t_u$ . При  $t_u \geq 10^{-3}$  с амплитуда сигнала достигает максимальной величины. С уменьшением длительности заполняющих импульсов амплитуда сигнала падает на  $\approx 20\%$ , одновременно наблюдаются появление и рост сигнала с центра с энергией термоактивации эмиссии  $E_A = -0.12$  эВ, причем максимальное значение сигнала от центра  $E_c = -0.12$  эВ (A-сигнал) равно изменению амплитуды сигнала (B-сигнал) от центра  $E_c = -0.18$  эВ. При условии, что период следования импульсов много больше, чем постоянная времени термоэмиссии электронов для центра  $E_c = -0.18$  эВ, имеет место следующее соотношение между амплитудами A- и B-сигналов:  $\Delta C_A(t_u) + \Delta C_B(t_u) = \text{const}$  (рис. 2). Это позволяет заключить, что энергии термоактивации эмиссии  $E_A$  и  $E_B$  соответствуют не двум различным дефектам, а двум состояниям одного дефекта. Действительно, при временах заполнения ловушек электронами, много меньших времени их перестройки из состояния A в состояние B, в эксперименте регистрируется только A-состояние с энергией термоактивации эмиссии  $E_A$ . С увеличением длительности импульсов заполнения электронами

дефекты, захватив электрон, переходят в  $B$ -состояние, тем самым уменьшая амплитуду  $A$ -состояния. В то же время доля  $B$ -состояний растет, и при  $t_a \gg \tau_n$  (где  $\tau_n$  — характеристическое время перестройки состояния  $A \rightarrow B$ ) регистрируются только дефекты с энергией термоактивации эмиссии  $E_B$ . Подобное явление перестройки дефектов наблюдалось в [13].

Концентрация ловушек в состоянии  $B$  (при переходе  $A \rightarrow B$ ) описывается выражением

$$N_B(t_a) = N_0 [1 - \exp(-t_a/\tau_n)],$$

где  $N_0$  — концентрация центров, захвативших электрон, в начальный момент времени.

В свою очередь, времяя перестройки зависит от температуры и хорошо описывается в рамках модели реакции первого порядка

$$\tau_n = \tau_0 \exp(-E_T/kT),$$

где  $E_T = 0.15$  эВ — энергия активации перестройки  $A \rightarrow B$ , а  $\tau_0^{-1} = 2.8 \cdot 10^{12}$  с<sup>-1</sup> — частотный фактор.

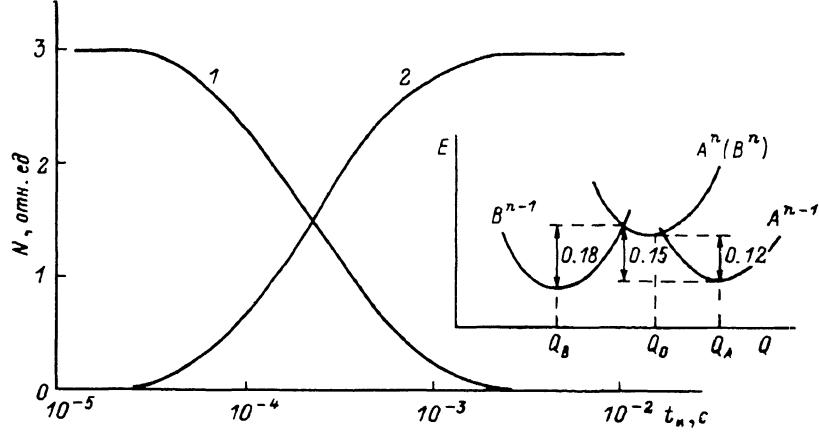


Рис. 2. Зависимость концентрации конфигурационно-бистабильного дефекта в состояниях  $A$  (1) и  $B$  (2) от длительности импульсов заполнения и его конфигурационно-координатная диаграмма.

Наблюдаемые переходы можно описать в рамках конфигурационно-координатной диаграммы [14], показанной на рис. 2. Незаполненному состоянию центра при наличии свободной пары электрон—дырка соответствует кривая  $A^n(B^n)$ , которая является общей для обоих состояний. В зависимости от температуры образца и времени заполнения центров электронами дефекты переходят в состояние, описываемое кривой  $A^{n-1}$  или  $B^{n-1}$ , соответственно характеризуемое новым равновесным значением обобщенной координаты  $Q_A$  или  $Q_B$ .

При низких температурах и коротких длительностях импульсов заполнения ( $t_a \leq 10^{-5}$  с) захват электрона переводит систему в состояние  $A^{n-1}$ . Энергия  $E_A$  соответствует термоактивированный переход из состояния  $A^{n-1}$  в  $A^n$ . При этом переход системы в состояние  $B^{n-1}$  ограничивается барьером  $E_T$ . С ростом температуры и длительности импульсов заполнения вероятность преодоления барьера  $E_T$  возрастает и дефекты переходят в состояние  $B^{n-1}$ . Переход системы из состояния  $B^{n-1}$  в состояние  $B^n(A^n)$  определяется величиной энергии термоэмиссии  $E_B$ . Так как состояние  $B^{n-1}$  при равновесном значении  $Q = Q_B$  характеризуется меньшей по сравнению с состоянием  $A^{n-1}$  ( $Q = Q_A$ ) величиной полной энергии, то конфигурация  $B$  является стабильной, а конфигурация  $A$  — метастабильной.

Следует отметить, что эффективность образования таких центров в бескислородных структурах выше примерно в 2 раза, чем в кислородных. На основании этого можно предположить, что в их состав не входит кислород. Отжиг бистабильного центра происходит на второй стадии. Однако, как видно из рис. 3, кроме него, на этой стадии отжигается еще один центр, который эффектив-

тивно вводится только в бескислородных образцах. В соответствии с [12] на данной стадии отжигаются комплексы  $C_i - C_s$ .

Кроме того, в интервале температур  $200 \div 280$  °С наблюдается дообразование углеродосодержащих дефектов с уровнем  $E_c + 0.34$  эВ (рис. 1, а). Возрастание концентрации этих центров существенно меньше, чем концентрация дефектов с уровнем  $E_c - 0.18$  эВ, отжигающихся на второй стадии. Это свидетельствует о диссоциации центров  $E_c - 0.18$  эВ с уходом части освободившегося углерода на дообразование центров  $E_c + 0.34$  эВ.

Рассмотрим некоторые особенности термического отжига центра  $E_c - 0.18$  эВ в кислородных образцах на основе НЛК и зонного кремния. Так же как и в бескислородных образцах, в них наблюдается конфигурационно-бистабильный центр, и стадия отжига  $200 \div 280$  °С обусловлена только им, поскольку комплекс  $C_i - C_s$  не образуется в этих структурах. Скорость введения центра с уровнем  $E_c - 0.18$  эВ (исключая бистабильный дефект) в кислородных образцах совпадает со скоростью введения  $A$ -центра в материале, полученном по Чохральскому, и составляет  $2.4 \cdot 10^{-4}$  см<sup>-1</sup>. Однако в интервале  $100 \div 200$  °С центры с уровнем  $E_c - 0.18$  эВ ( $E1$ ) перестраиваются в дефекты с уровнем  $E_c - 0.34$  эВ ( $E2$ ). При  $T > 200$  °С наблюдается обратная перестройка  $E2 \rightarrow E1$ .

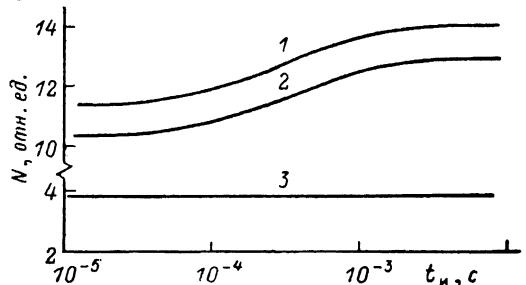


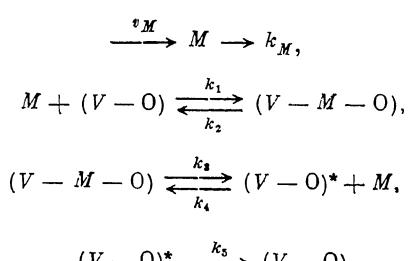
Рис. 3. Зависимость концентрации центров с уровнем  $E_c - 0.18$  эВ в «бескислородных» образцах от длительности импульсов заполнения на различных стадиях отжига.

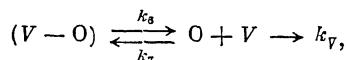
1 — после облучения; после отжига  $T, \text{ }^{\circ}\text{C}:$   
2 — 180, 3 — 300.

Процесс перестройки идет с сохранением полного числа дефектов до 250 °С. Поскольку в кристалле всегда есть большое количество стоков для компонент отжигающихся дефектов [15], то процесс полной взаимной перестройки вероятнее связать с изменением конфигурации дефектов, а не с их отжигом.

Для более детального изучения наблюдаемой перестройки проводился изотермический отжиг образцов при нескольких температурах. На рис. 4 показаны результаты отжига при 320 °С. Для исключения влияния распада комплексов, наблюдаемого при больших временах отжига, концентрации центров  $E1$  и  $E2$  нормированы на их суммарную концентрацию для текущего времени отжига:  $f = N_{1,2}(t)/[N_1(t) + N_2(t)]$ . В течение первых  $\sim 5$  с происходит полное исчезновение дефектов  $E1$ , сопровождающееся появлением в такой же концентрации дефектов  $E2$ . В дальнейшем процесс идет в обратном направлении: центры  $E2$  исчезают, а вместо них появляются дефекты  $E1$ . Таким образом, концентрация дефектов с уровнем  $E_c - 0.18$  эВ испытывает полный цикл колебаний (появление — исчезновение — появление). Возможность наблюдения поведения системы дефектов во времени при  $t > 10^6$  с ограничена термическим распадом  $A$ -центра. Попытки исследования колебательного режима перестройки дефектов при более низкой температуре показали, что время перехода системы дефектов из одного состояния в другое возрастает на несколько порядков, что делает проведение такого эксперимента нереальным.

Для описания наблюдаемого поведения дефектов  $E1$  и  $E2$  во времени предлагаются следующая схема [16]:





где  $M$  — подвижный при  $T \geq 100$  °С дефект, генерируемый со скоростью  $v_M$  и уходящий на сток с константой скорости  $k_M$ , причем скорости его генерации и ухода на стоки зависят от времени. Захват комплексом  $(V-O)$  подвижной компоненты  $M$  приводит к структурной перестройке центра через промежуточное состояние  $(V-M-O)$  в состояние  $(V-O)^*$ , дающее в запрещенной зоне уровень  $E_c = 0.34$  эВ. Эта структурная перестройка сопровождается высвобождением компоненты  $M$ . В дальнейшем идет перестройка  $(V-O)^* \rightarrow (V-O)$ . Последнее уравнение описывает термический распад комплекса  $(V-O)$  с уходом вакансий на стоки. Существенным для возникновения колебаний в данной схеме, как и в случае [17], является связывание компоненты  $M$  комплексом  $(V-O)$  с последующим ее высвобождением.

Из рис. 4 видно, что время перестройки  $E1 \rightarrow E2$  составляет  $\sim 5$  с, а обратного процесса  $E2 \rightarrow E1$  —  $\sim 10^6$  с. Это указывает на существенное возрастание

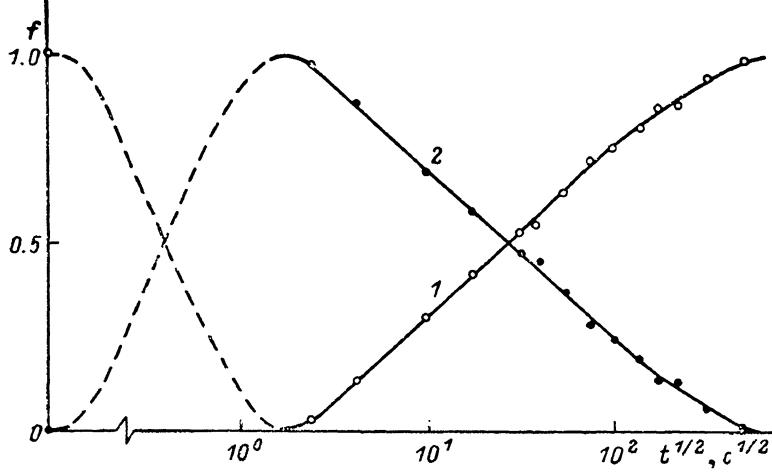


Рис. 4. Зависимость нормированной концентрации дефектов от времени изотермического отжига в «кислородных» образцах ( $T=320$  °С).

1 —  $E_c = 0.18$  эВ ( $E1$ ), 2 —  $E_c = 0.34$  эВ ( $E2$ ).

«периода» колебаний. Такая ситуация может реализоваться, поскольку, как показано в [17], период колебаний зависит от скоростей поступления взаимодействующих веществ. В нашем случае, например, можно предположить изменение скорости поступления дефекта  $M$  в результате истощения его источника.

Изучение кинетики перестройки (в предположении реакции первого порядка) позволило оценить энергию активации процесса перехода  $E1 \rightarrow E2$ , которая составляет 0.7 эВ. В первом приближении энергию активации трансформации  $E1 \rightarrow E2$  можно связать с энергией миграции дефекта  $M$ . Сравнение полученного значения для энергии активации процесса перестройки с данными для энергии миграции собственных междоузельных атомов (0.85 эВ) и атомов углерода (0.80 эВ) в кремнии [18] дает удовлетворительное совпадение. Это позволяет предположить, что в данном случае подвижным дефектом  $M$ , приводящим к колебательной реакции взаимодействия дефектов, могут быть атомы углерода или собственные междоузельные атомы кремния.

**Заключение.** Изучение неравновесных процессов релаксации (дефект — окружающая решетка) при изменении зарядовых состояний центров дает дополнительную информацию о природе дефектов.

Исследование таких процессов позволило установить, что в отличие от имеющегося в литературе мнения, что уровень  $E_c = 0.18$  эВ обусловлен двумя дефектами ( $A$ -центр и комплекс  $C_i-C_s$ ), указанному энергетическому уровню могут соответствовать по крайней мере четыре типа дефектов, отжигающихся в три стадии. Исследование процессов релаксации решетки при изменении за-

рядового состояния этих дефектов дало возможность идентифицировать один из них как конфигурационно-бистабильный и выделить его вклад. Предполагается, что он не является  $A$ -центром.

Показано, что дефект с уровнем  $E_c = 0.18$  эВ, отжигающийся на первой ( $100 \div 140$  °С) стадии, по-видимому, не содержит углерода и его отжиг нельзя объяснить взаимодействием с  $E$ -центром.

В образцах с большим содержанием кислорода обнаружена колебательная реакция перестройки дефектов с уровнем  $E_c = 0.18$  эВ в дефект с уровнем  $E_c = -0.34$  эВ. Предложена модель такого процесса с участием  $A$ -центра. Экспериментально показана возможность существования колебательной реакции взаимодействия дефектов в полупроводниках.

### Л и т е р а т у р а

- [1] Watkins G. D., Brower K. L. — Phys. Rev. Lett., 1976, v. 36, N 22, p. 1329—1332.
- [2] Brower K. L. — Phys. Rev. B: Sol. St., 1974, v. 9, N 6, p. 2607—2610.
- [3] Литвинко А. Г., Макаренко Л. Ф., Мурин Л. И., Ткачев В. Д. — ДАН БССР, 1979, т. 23, в. 6, с. 522—524.
- [4] Corbett J. W., Watkins G. D., Chrenko R. M., McDonald R. G. — Phys. Rev., 1961, v. 121, N 4, p. 1015—1022.
- [5] Watkins G. D., Corbett J. W. — Disc. Farad. Soc., 1961, v. 31, p. 86—95.
- [6] Лугаков П. Ф., Лукьяница В. В. — ФТП, 1983, т. 17, в. 1, с. 166—168.
- [7] Murin L. I. — Phys. St. Sol. (a), 1986, v. 93, N 2, p. K147—K149.
- [8] Guldberg J. — J. Phys. D: Appl. Phys., 1978, v. 11, N 14, p. 2043—2057.
- [9] Кучинский П. В., Ломако В. М., Шахлевич Л. Н. — ФТП, 1987, т. 21, в. 8, с. 1471—1473.
- [10] Kimerling L. C. — In: Rad. Eff. Semicond. Conf. Ser. N 31. Bristol—London, 1977, p. 221—230.
- [11] Губская В. И., Кучинский П. В., Ломако В. М. — ФТП, 1986, т. 20, в. 6, с. 1055—1059.
- [12] Литвинко А. Г., Макаренко Л. Ф., Мурин Л. И., Ткачев В. Д. — ФТП, 1980, т. 14, в. 4, с. 776—780.
- [13] Jellison G. E. — J. Appl. Phys., 1982, v. 53, N 8, p. 5715—5719.
- [14] Кучинский П. В., Ломако В. М., Шахлевич Л. Н. — Письма ЖЭТФ, 1986, т. 43, в. 9, с. 423—425.
- [15] Gubskaya V. I., Kuchinskii P. V., Lomako V. M. — Rad. Eff., 1981, v. 55, N 1-2, p. 35—38.
- [16] Кучинский П. В., Ломако В. М., Шахлевич Л. Н. — Письма ЖЭТФ, 1987, т. 45, в. 7, с. 350—352.
- [17] Сельков Е. Е., Назаренко В. Г. — Биофизика, 1980, т. 25, в. 6, с. 1006—1010.
- [18] Емцев В. В., Машовец Т. В. Примеси и точечные дефекты в полупроводниках. М., 1981. 248 с.

Научно-исследовательский институт  
физических проблем  
им. А. Н. Севченко при БГУ им. В. И. Ленина  
Минск

Получена 15.07.1987  
Принята к печати 14.01.1988